

学校・研究機関のみならず

アカデミックカタログ

2023年度

フィルメトリクス株式会社では、長年に亘り光学式膜厚測定装置を販売し、国内の大学・官公庁をはじめとする研究機関や、半導体・化学材料・医療・自動車関連等様々な企業で御使用頂いております。

膜厚測定システム

F20

世界中で 5000 台以上使用されているベーシックモデル！



FILMETRICS
A KLA Company

F20

- ・膜厚測定範囲 15nm ~ 70 μ m F20 本体、測定ステージ、制御パソコン、膜厚サンプル 他
- ・測定波長領域 380 - 1050nm

価格

アカデミック特別価格

数量限定!
納期2ヶ月!!

F20-UV

- ・膜厚測定範囲 1nm ~ 40 μ m F20 本体、UV 光源、測定ステージ、制御パソコン、膜厚サンプル 他
- ・測定波長領域 190 - 1100nm

価格

アカデミック特別価格

数量限定!
納期2ヶ月!!

F20-UVX

- ・膜厚測定範囲 1nm ~ 250 μ m F20 本体、UV 光源、測定ステージ、制御パソコン、膜厚サンプル 他
- ・測定波長領域 190 - 1700nm

価格

アカデミック特別価格

共通仕様

御見積・御購入の前に、測定の可否、装置仕様のご確認をお願いいたします。

- ① F20 : 膜厚の $\pm 0.2\%$ 、もしくは 2nm いずれか大きい値
- F20-UV / UVX : 膜厚の $\pm 0.2\%$ 、もしくは 1nm いずれか大きい値

(注) 当社が提供する Si 基板上の SiO₂ 膜を測定した場合の機器本体の正確性

- ② 取り扱い説明は現地またはオンラインで実施

フィルメトリクス株式会社

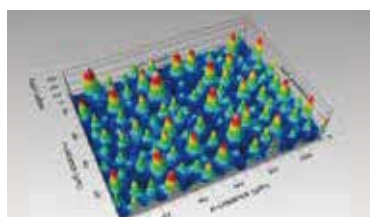
〒222-0033 横浜市港北区新横浜2-5-9 新横浜フジカビル8F Tel: 045-473-7109
Email: info@filmetrics.co.jp URL: www.filmetrics.co.jp

3次元表面形状測定システム

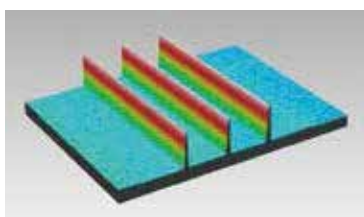
表面形状・段差・粗さ測定システムを身近に！

1台でナノオーダーの表面粗さ測定からミリオーダーの形状段差測定まで可能です。

段差測定範囲	～ 10 mm
段差測定正確性	0.7%
XY 分解能	最小 0.4μm
測定ステージ	100×100mm 200×200mm



ポリマー混合物の3次元形状



導波路型回折格子

Profilm3D

FILMETRICS
A KLA Company



Profilm3D 装置本体 (XY 自動測定ステージ / 手動レボルバー / 10 倍干渉レンズ)、制御用 PC、卓上型アクティブ除振台

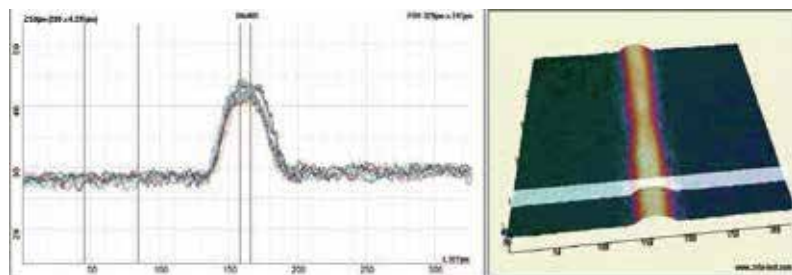
価格

アカデミック特別価格

マルチ共焦点顕微鏡システム

独自の ZDot™ テクノロジーで高速測定！

非接触で段差・粗さ・寸法の測定結果を True Color 画像で表示します。デュアル光源を搭載し、高反射率部と低反射率部を同時に測定できます。



太陽電池サンプル 反射率が 95% の銀電極部と 1% 以下の黒いセル部を同時に測定

Zeta-20

KLA+
INSTRUMENTS



価格

アカデミック特別価格

オンラインでサンプル測定やデモを実施していますので、お気軽にお問い合わせ下さい

フィルメトリクス株式会社

資料請求等のお問合せ先は

メール : info@filmetrics.co.jp